Оптический профилометр IntoM OP300

Измерение крупногабаритной микротрехмерной формы в один клик

- Плоскость формы большого размера
- Совместимые 12-дюймовые вакуумные присоски
- Автоматизированное измерение полупровод-никовых пластин



Специальные функции в области полупроводников

- Одновременно поддерживает измерение кремниевых полупроводниковых пластин трех размеров (6, 8 и 12 дюймов) и выполняет автоматическое переключение трех видов вакуумных присосок для адаптации к кремниевым полупроводниковым пластинам разных размеров в один клик.
- Обладает функцией автоматического измерения шероховатости утонченного листа после процесса шлифования и
- может в один клик измерить шероховатость десятков небольших областей для получения среднего
- Обладает функцией измерения контурных данных глубины и ширины канала после его лазерного прорезания в процессе скайбирования и может в один клик выполнить измерение и анализ данных поверхности и нескольких секционных линий поверхности, связанных с глубиной и шириной канала.
- Благодаря измерению высоты уступа покрытия во время изготовления кремниевых полупроводниковых пластин
- с диапазоном измерения от 1 нм до 1 мм реализует высокоточные измерения.

Технические характеристики

Модель прибора				IntoM OP300			
Габариты прибора				(1000X900X1500) MM			
Вес системного блока прибора				< 500 кг			
Источник света				Белый свет LED			
Система изображения				1024X1024			
Интерференционный объектив				10X,(2.5X,5X, 20X,50X,100X)			
Оптический ZOOM				0.5X, (0.75X , 1X , 0.375X)			
Станда	Стандартное поле обзора				0.98Х0.98мм		
Вышка объектива				5 электрических отверстий			
		Размер		450Х450мм			
XY перемещающаяся платформа		Диапазон перемещения		300Х300мм			
		Нагрузка		10кг			
		Спо	соб управления	Электрический			
Настройка уровня				±6°,электрический			
Фокус оси Z		Ход		100мм			
		Способ управления		Электрический			
Диапаз	Диапазон сканирования направления Z				10мм		
Разрешение направления Z				0.1нм			
Измеримый коэффициент отражения образца				0.05%-100%			
Повторяемость RMS шероховатости			тости	0.005нм			
Измерение шага			Точность	0.3%			
7.5.10	измерение шага		Повторяемость		0.08% 1σ		
Экологические требования							
1	Рабочая среда: нет мощного магнитного поля, нет разъедающего газа.			4	Вибрация окружающей среды: VC-C или лучше		
Рабочая температура: 15°C~30°C, температурный градиент 2°C/60 мин			15°C~30°С, температурный	5	Источник воздуха с виброизоляцией: источник чистого воздуха, 0.8 Мра регулирование давления источника чистого воздуха, обезжиривание, осушение, диаметр воздушной трубы 6 мм (опционально)		
3	3 Относительная влажность: 5–95 %RH, без конденсации влаги.			6	Источник питания: 330 Bт		
Прочие требования							
1	1 Источник света не следует держать в ярком режиме в течение длительного времени.				Не шатайте прибор руками во время измерения.		